JPAB

CLIPPEDIMAGE= JP403292578A

PAT-NO: JP403292578A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03292578 A FINGERPRINT READING DEVICE

PUBN-DATE: December 24, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KAWASAKI, KOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY N/A

NIPPONDENSO CO LTD

APPL-NO: JP02096697

APPL-DATE: April 11, 1990

INT-CL (IPC): G06K009/00; A61B005/117; G06F015/64

US-CL-CURRENT: 382/127

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a fingerprint picture faithful to an actual fingerprint by

providing an optical correcting member to correct a component parallel to the

optical axis of the whole optical path length from a fingerprint detecting

plane to the main point of a lens so as to be approximately equal to the

optical path length on the optical axis between a fingerprint detecting member and the lens.

CONSTITUTION: A correcting prism 8 makes all the light reflected at the any

spot of a fingerprint detecting plane 2 trace equal distance and reach a main

point K of the front side of a lens 11. All the light reflected at the

fingerprint plane 2 reaches the main point K of the lens 11 with equal optical

path length with passing through the correcting prism 8.

Accordingly, actual

fingerprints on the fingerprint detecting plane 2 are

image-formed as a

fingerprint picture on a CCD light receiving plane 12 at an equal magnification

without relation with parts and the generation of magnification difference in

the fingerprint picture is prevented. Thus, the fingerprint

picture faithful to the actual fingerprints can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

· 图日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平3-292578

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月24日

G 06 K 9/00 A 61 B 5/117 G 06 F 15/64

G 8945-5L

8932-4C A 61 B 5/10

322

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全11頁)

指紋読取装置

②特 願 平2-96697

❷出 願 平2(1990)4月11日

@発明者 川崎 @出願人 日本電装 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

日本電装株式会社、 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

四代 理 人 弁理士 恩田 博宜 外1名

明細書

発明の名称 指紋読取装置

2. 特許請求の範囲

1. 透明なる指紋検出部材に指紋検出面を形成し、同指紋検出面上に指先を接触させた状態で指紋検出面の裏面に光顔から光を照射し、同指紋検出面から反射された光をレンズを介して撮像素子上に指紋画像として結像させてなる指紋読取装置において、

前記指紋検出部材とレンズとの間に、前記指紋 検出面からレンズの主点までの全ての光路長の光 軸に平行な成分を同光軸上の光路長とほぼ等しく なるように補正する光学補正部材を配設したこと を特徴とする指紋読取装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕.

この発明は指紋読取装置に係り、詳しくはクレジットカード等において登録者を識別するために その指紋を指紋画像として読み取る指紋読取装置 に関するものである。

〔従来の技術〕

従来の指紋読取装置としては実開昭63-99 960号公報に記載のものがある。第13図に示すように、この指紋読取装置は三角柱状の指紋絞出で無理を指紋検出面22としての指紋検出面22を原立しない光を、指紋検出面22に対して、反射された光を、指紋やしてCCD受光面24上に結像させるようになっている。

そして、上記した指紋検出面 2 2 に指先を接触させると、指紋の凸部のみが指紋検出面 2 2 にの間には空気が乱には空気が大きした。その結果、指紋検出面 2 2 の裏面に入射した光は空気が介在している箇所のみが全反射して、前記 C C D 受光面 2 4 上に指紋画像として結(像する。そして、このようにして得られた指紋画像とアめ記憶された指紋画像とパターンマッチングし、一致するか否か(本人か否か)を判定して

いる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記した指紋読取装置においては、指紋検出面22に対してレンズ23を傾けて配置していることから、指紋検出面の反射箇所に応じてレンズ23までの光路長が変動し、それに伴って指紋画像の倍率が変動してしまう。即ち、第13図において指紋検出面22のA点からレンズ23の前側主点Kまでの距離をa、レンズ23の後側主点K、からCCD受光面24までの距離をbとすると、このA点での倍率mは、

m = b / a

となる。

又、レンズ 2 3 の焦点距離を f とすると、レン ズの一般式より、

1/f = (1/a) + (1/b)

 $\therefore m = f / (a - f)$

と表される。

又、上記した A 点よりレンズ 2 3 と反対側 (説明の便宜上、負側とする) に Δ S ずれた点を B 点

(課題を解決するための手段)

指紋検出面上に指先を接触させてその指紋検出面の裏面に光原から光を照射すると、その光は指紋検出面に反射され光学補正部材にて屈折された後に、レンズを介して機像案子上に結像する。このとき指紋検出面の指紋が密着していない箇所のみが光を全反射することから、機像案子上には指紋の凹凸に応じた指紋画像が結像する。

上記したように指紋検出面で反射された光は光

とし、 B 点からレンズ 2 3 の前側主点 K までの距離を a 、 レンズ 2 3 の後側主点 K から C C D 受光面 2 4 までの距離を b とすると、この B 点での倍率 m は、

m' = b' /a' = f / (a' - f) となり、ここで、

 $a' = a + \Delta S \cos \theta$ であるので、 $m' = f / (a + \Delta S \cos \theta - f)$ となる。

よって、A点での倍率mに対しB点での倍率m'は小さくなる。そして、このような倍率差が生じると、指紋登録時と指紋照合時の検出位置が異なる場合、例えば、A点で指紋を登録しB点で指紋を照合した場合等には、パターンマッチングの際に一致する画素数が減少して照合率が低下してしまう。その結果、同一指紋であるにも拘らず異なる指紋であると判定される虞がある。

本発明の目的は、倍率差の発生を防止して実際 の指紋に忠実な指紋画像を得ることができる指紋 読取装置を提供することにある。

学補正部材にて屈折され、レンズの主点に到達するまでの光路長の光軸に平行な成分は同光軸上の光路長にほぼ等しくなるように補正される。従って、指紋検出面上の実際の指紋は、その部位に関係なく全て等しい倍率で撮像素子上に指紋画像として結像し、指紋画像中の倍率差の発生が防止される。

〔実施例〕

以下、この発明を具体化した一実施例を第1~ 12図に従って説明する。

て構成されている。本実施例の指紋読取装置においては、前記拡散板 5 の厚みが指紋検出面 2 に近い側ほど厚く設定されている。

又、指紋検出プリズム1の投光面4側には三角柱状をなす光学補正部材としての補正プリズム8は、その1項点が当接している。補正プリズム8は、その当接した頂点の片側の平面を受光面9とするとした頂点と相対向する平面を投光面10には所定間隔をおいて相対向するようにレンズ11が配設され、レンズ11の反対側には撮像素子としてのCD素子の受光面12が配設されている。

そして、光顔7のLED6から照射される光は 拡散板5にて拡散された後に、指紋検出プリズム 1内に採り入れられて指紋検出面2に入射する。 さらに、その光は指紋検出面2の裏面で反射され て指紋検出プリズム1の外部に導かれ、補正プリ ズム8内に採り入れられて屈折した後に、レンズ 11を介してCCD受光面12上に結像される。 上記した補正プリズム8は、指紋検出面2のい

介してCCD受光面12上に結像される。

従って、指紋検出面 2 に指先 1 3 を当接させると指紋の凸部のみが指紋検出面 2 に密着 る。そ類した在する。そ類の結果、指紋検出面 2 の裏面に入射し、そ気レンを無いる箇所のみが全反射し、そのととはならでで、このC C D 受光面 1 2 に指紋をして、このC C D 受光面 1 2 と接続された処理装置 1 4 により得られた指紋をを表された指紋画像とパターンマッチるにより登された指紋画像とパターンマッチをあるか否か(本人か否か)を判定するか否か(本人か否か)を判定する。

又、上記したように指紋検出面2で反射された全ての光は、補正プリズム8を通過することで等しい光路長でレンズ11の主点Kに到達する。従って、指紋検出面2上の実際の指紋は、その部位に関係なく全て等しい倍率でCCD受光面12上に指紋画像として結像し、指紋画像中の倍率差の発生が防止される。

一方、上記したようにLED6からの光は指紋

ずれの箇所で反射された光でも全て等しい距離 (以下、光路長という)を辿ってある。。但な というとかってある。。但な のの主点を対してある。過去性 のの主点を対しているを通過といってある。過去性 というのでははいってができるが、 というのではないでは、 を通過がいては、 を通過がいたが、 を通過がいたが、 を通過がいたが、 を通過がいたが、 を通過がいたが、 を通過がいたが、 を通過が、 がいたが、 を通過が、 がいたが、 を通過が、 がいたが、 がいが、 が

次に、このように構成した指紋読取装置の作用 を説明する。

光顔7のLED6から光が照射されると、その 光は拡散板5にて拡散された後に指紋検出プリズム1の指紋検出面2の裏面側に入射して同指紋検 出面2で反射される。さらに、その光は補正プリズム8内を通過して屈折した後に、レンズ11を

第11図は本実施例の指紋読取装置によって得られた指紋画像をパターンマッチングのためにNTSC方式等の映像信号に変換した状態を示す。又、第12図は平坦な拡散板を用いたり拡散を用いたりした場合の指紋読取装置によるを映像信号を示す。尚、これらの図において機軸は上の位置変位(例えば、第1図においては左右方向の位置変位)を示す。

第12図においては指紋画像の明るさにむらが 生じているため、その指紋画像を変換した映像信 号に傾きが生じる。従って、映像信号を2値化閾値により2値化したときに、本来指紋の凹凸を表しているはずの映像信号の一部(第12図におけるT部分)が消失して忠実な信号を得ることができない。これに対して本実施例の指紋読取装置においては指紋画像の明るさが均一なため、その指紋画像を変換した映像信号も平坦になり、映像信号を2値化しても指紋の凹凸を表している映像信号の消失が防止される。

次に、本実施例の指紋読取装置の具体的な仕様、例えば、指紋検出プリズム1と補正プリズム8の形状や相対的な位置等を決定するための手順を記載する。

まず、指紋検出面2の部位に応じたCCD受光面12上の指紋画像の倍率を第2図に基づいて計算する。尚、第2図において指紋検出プリズム1の頂点をA、B、Cとし、補正プリズム8の頂点をD、E、Fとする。又、指紋検出面2の中心をG点(0,0)として、このG点を座標の原点位置(0,0)とする。さらに、G点で反射される

となる。

又、補正プリズムの頂点D, E, Fの座標は次のようになる。

D (Dx, Dy)

 $D x = X \sin (\pi / 2 - \xi_0)$

 $D y = X \cos (\pi / 2 - \xi_0) D x$

 $-L\cos(\pi/2-\xi)$

E(Ex.Ev)

x 軸に対するDEの傾き:α-

 $\alpha = \tan (\xi_0 - \theta_0)$

DEのy軸との交点:β

 $\beta = D y - tan (F_0 - \theta_a) D x$

求める点E (Ex, Ey) は、

 $(E x - D x)^{2} + (E y - D y)^{2} = R^{2} + b$

 $E x = \{-\nu + \sqrt{\nu^2 - 4 \cdot (1 + \alpha^2) \cdot \delta}\}$

 $/2 (1 + \alpha^2)$

 $\nu = 2 \alpha \beta - 2 D x - 2 \alpha D y$

 $\delta = D x^2 + \beta^2 - 2 D y \beta + D y^2 - R^2$

 $E y = \alpha E x + B$

ここで、補正プリズム8での光線の入射位置で

まず、指紋検出プリズム1のG点で反射された 光が指紋検出プリズム1外に出射される位置であるH点の座標を求めると、

H (Hx, Hy)

 $Hx = L \sin F_0 / \{ \tan F_0 \}$

+ tan $(\pi/2-\theta_1)$

 $Hy = -\tan (\pi/2 - \theta) Hx$

ある点 I 及び出射位置である点 J は次のようになる。

I(Ix, Iy)

 $\theta = \theta - \xi$

 $\theta_1 = \sin^{-1} \left(n \cdot 1 \sin \theta_1 \right)$

I 点はDEとHIの交点であるので、

I $y = tan (\xi - \theta)$ I x + D y

- tan $(\xi \cdot - \theta \cdot)$ D x

及び、

1 y = - tan ($\pi / 2 - \theta$, - θ ₁) 1 x + H y

+ tan $(\pi/2-\theta_1-\theta_2)$ H x

の2つの式が成り立つ。よって、

I x = $[Hy + tan (\pi/2 - \theta_1 - \theta_2)]$ H x

+ E y + tan ($F_0 - \theta_1$) E x] / [tan

 $(F_0-\theta_1)$ + tan $(\pi/2-\theta_1-\theta_2)$]

 $I y = -\tan (\pi / 2 - \theta \cdot - \theta \cdot) I x + H y$

+ tan $(\pi/2-\theta,-\theta)$ H x

J(Jx, Jy)

 $\theta = \theta + \theta$

 $\theta = \sin^{-1} (\sin \theta / n 2)$

$$\mu_1 = \pi / 2 - \theta \cdot - \theta_2 + \theta_3 - \theta \cdot$$
J点は $\overline{1J} \succeq \overline{EJ}$ の交点であるので、

 $J y = -\tan (\mu_1) J x + I y$
 $+ \tan (\mu_1) I x$
及び、

 $J y = \tan (\phi_1 + \xi_0 - \theta_1) J x + E y$
 $- \tan (\phi_1 + \xi_0 - \theta_1) E x$
の 2 式が成り立つ。よって、

 $J x = \{I y + \tan (\mu_1) I x - E y$
 $+ \tan (\xi_0 - \theta_1 + \phi_1) E x\}$
 $/ \{\tan (\xi_0 - \theta_1 + \phi_1)$
 $+ \tan (\mu_1) \}$
 $J y = -\tan (\mu_1) J x + I y$
 $+ \tan (\mu_1) I x$

倒光線の相対角度をheta,とすると、CCD受光面I2の大きさと倍率mよりheta,は、

 $\theta i = tan (\overline{NU} / \ell)$

 $\ell = f (1 + m)$

と表される。

この光線をCCD受光面12上のUから逆追跡して指紋検出プリズム1の指紋検出面2のどの位置に到達するかを求める。まず、補正プリズム8への入射位置である点Mの座標を求めると、

M(Mx, My)

 $\mu = \mu - \theta$

M点は $\overline{ME} \succeq \overline{MK}$ の2直線の交点であるので、 $My = tan(F_0 - \theta_1 + \phi_1) Mx + Ey$ $-tan(F_0 - \theta_1 + \phi_1) Ex$

及び、

 $M y = - tan (\mu_1) M x + K y$ + tan (\mu_1) K x

の 2 式が成り立つ。よって、

 $M x = \{K y + tan (\mu_*) K x - E y + tan' (F_0 - \theta_* + \phi_1) E x\} /$

で主点Kは、

К (Кх, Ку)

 $\theta = \pi - \phi_1 - \phi_2 - \theta_4$

 $\theta = \sin^{-1} (n 2 \sin \theta)$

 $\mu_1 = \mu_1 + \theta_4 - \theta_5$

 $\varepsilon = -\tan (\mu_z)$

 $\zeta = J y + tan (\mu_z) J_X$

 $\eta = 2 \varepsilon \zeta - 2 J x - 2 J y \varepsilon$

 $\iota = J x^{2} + J y^{2} - \overline{J K^{2}} + \zeta^{2} - 2 J y \zeta$

 $K x = \{-\eta + \sqrt{\eta^2 - 4(1 + \varepsilon^2)}\}$

/ [2/(1+e²)]

 $K y = - tan (\mu_z) K x + J y + tan (\mu_z) J x$

となる。以上のようにして指紋検出面2のG点からの光線の軌跡(光軸 X)をシュミレートすることができる。

次に、この条件で最も低倍率側 (Q点に到達する光線) の軌跡をシュミレートする。

レンズ11の後側主点K'からCCD受光面12までの距離をl.とし、光軸Xに対する低倍率

$$\{ \tan (\xi_0 - \theta_a + \phi_1) + \tan (\mu_2) \}$$

$$M y = \tan (\xi_0 - \theta_a + \phi_1) M x + E y$$

$$- \tan (\xi_0 - \theta_a + \phi_1) E x$$

となる。

次に、補正プリズム 8 からの出射位置である点 〇を求めると、

0 (0x, 0y)

 $\theta = \theta - \theta$

 $\theta = \sin^{-1} \{ (\sin \theta) / n 2 \}$

 $\mu = \mu : -\theta : +\theta :$

O点はOEとOMの交点であるので、

 $O y = tan (F_0 - \theta_0) \cdot O x + E y$

- tan $(F_0 - \theta_0)$ E x

 $O y = - tan (\mu_4) O x + M y$

+ tan (μ₄) M χ

となり、よって、

 $0 x = \{M y + \tan (\mu_{\bullet}) M x - E x' + \tan (F_{\bullet} - \theta_{\bullet}) E x\} / \{\tan (F_{\bullet} - \theta_{\bullet}) + \tan (\mu_{\bullet})\}$

 $O y = tan (F_0 - \theta_0) O x + E y$

ー tan (f • ー θ •) E x のようになり、さらに指紋検出プリズム l への入

P (Px, Py)

射位置である点Pは、

 $\theta_{10} = \pi - \phi_{1} - \phi_{2} - \theta_{0}$

 $\theta_{11} = \sin^{-1} (n 2 \sin \theta_{10})$

P点はBPとPOとの交点であるので、

 $P y = tan F \cdot P x - L sin F \cdot$

及び、

 $P y = - tan (\mu_4 - \theta_{11} + \theta_{10}) P x$

 $+ O y + tan (\mu_4 - \theta_{11} + \theta_{10}) P x$

の2式が成り立つ。よって、

 $P x = \{ O y + tan (\mu_4 - \theta_{11} + \theta_{10}) O x + L sin (F_0) \}$

/ $\{ \tan \xi_0 + \tan (\mu_4 - \theta_{11} + \theta_{10}) \}$

 $P y = tan \xi \cdot P x - L sin \xi \cdot$

となる。そして、指紋検出面 1 に到達する位置である点Qは、

Q(Qx, 0)

 $\theta_{12} = \theta_{11} - \theta_{\bullet}$

な成分は $\overline{JK}-\overline{MJ}\sin\theta$ となる。倍率m はこれらすべてを加算した値で ℓ を割ったものとなる。

一方、指紋検出面 2 上において G 点を中心として Q 点と反対側に位置する S 点は μ . を、

 $\mu_1 = \mu_1 + \theta_1$

と代えることで同様の手順で求めることができる。 これにより求めたS点での倍率m゚は、

$$m'' = \ell \cdot / \{\overline{QP'} \cos(\theta_1 \cdot ' - \theta_2) / n \}$$

$$+ \overline{PO'} \cos(\theta_1 \cdot - \theta_2)$$

$$+ \overline{OM'} \cos(\theta_1 \cdot - \theta_4) / n \}$$

$$+ (\overline{JK + MJ'} + \sin\theta_1) \}$$

となる。

以上のようにして求めたm, m', m"を等しくなるようにすれば倍率差の発生を防ぐことができる。そして、このQ点、S点での倍率m', m"

 $\theta_{12} = \sin^{-1} \left\{ \sin \left(\theta_{12} \right) / n \right\}$ $\mu_{5} = \mu_{4} - \theta_{11} + \theta_{10} + \theta_{12} - \theta_{12}$ $Qx = \left\{ Py + \tan \left(\mu_{5} \right) Px \right\} / \tan \left(\mu_{5} \right)$ $\theta_{14} = \pi / 2 - \mu_{5}$

(この θ 1. は臨界角条件を満たさねばならない) 以上より Q 点からレンズの中心に到達する光線 の距離は、

 $\overline{QK} = \overline{QP} / n \ 1 + \overline{PO} + \overline{OM} / n \ 2 + \overline{MK}$ $\overline{QK} = \sqrt{(Qx - Px)^2 + (Qy - Py)^2} / n \ 1$ $+ \sqrt{(Px - Ox)^2 + (Py - Oy)^2}$ $+ \sqrt{(Ox - Mx)^2 + (Oy - My)^2} / n \ 2$ $+ \sqrt{(Mx - Kx)^2 + (My - Ky)^2}$ $\geq 4 \ 3 \ 6$

は以下に示す要因で変化する。

- 1. 指紋検出プリズム1の角を。
- 2. 指紋検出プリズム1と補正プリズム8とがな す角θ。
- 3. 補正プリズム8の角。
- 4. 指紋検出プリズム 1 及び補正プリズム 8 の材質
- 5. レンズ11の焦点距離 f
- 6. 反射光線の反射の角度θ,と反射光λの波長
- 7. 画像の中心倍率m
- 8. CCD受光面12の長さ

従って、これらの要因を適宜設定することで、 各点G、Q、Sでの倍率m、m'、m'を等しく して倍率差の発生を防止することができる。

次に、本実施例の指紋読取装置の具体的な仕様 をシュミレーションプログラムに基づいて選定する

上記した各項の変化要因を考慮してG、Q、S 点での倍率を求めるが、変化要因が1項から8項 まで多数あるため以下の条件を予め設定しておく。 まず、1項目の角を。については、指紋検出プリズム1を直角をなす辺の長さか25mmの直角プリズムとすることからを。=45°とする。又、4項目の指紋検出プリズム1と補正プリズム8の材質についてはBK7とし、6項目の反射光入の波長としては660nm、7項目の中心倍率をm=0.5、8項目のCCD受光面12の長さを6.4mmに選定する。

又、指紋検出プリズム 1 と補正プリズム 8 とが 当接する D 点は指紋検出プリズム 1 の Q 点からの 光を妨げない位置に選定する必要があることから C D = 5 m とする。さらに、補正プリズム 8 は直 角プリズムとし、その辺 D E は指紋検出プリズム 1 の S 点からの光を入射可能な長さが必要なこと から D E = 2 5 mmとする。

以上の条件により 2 項目の両プリズム 1 , 8 がなす角 θ 。 、3 項目の補正プリズム 8 の角 ϕ 。 5 項目のレンズ 1 1 の焦点距離 f 、6 項目の反射 光線の反射角度 θ 、を求める。

まず、補正プリズム8の角φ,は反射光線の反

中心での倍率より低くなっていることから45°から60°の間に最適値が存在することが予測できる。

従って、 ϕ 1 を 45° より 1° ずっ増加させた 45° より 1° ずっ増加させた 45° より 1° が 10 増加 10 増加 10 を 10 もの 10 もの 10 を 10 もの 10 を 10 を

よって、補正プリズム 8 の角 ϕ , を 4 5 $^\circ$ 、 レンズ 1 1 の焦点距離 f は光学系の大きさを考慮して 2 5 mとする。又、反射光線の反射角度 θ , は 第 3 , 5 図より 4 5 $^\circ$ 以上であれば臨界角条件を 満足するが、製作・組付誤差を考慮して θ , = 4

又、第4図はG点での反射角 θ , と補正プリズム8の角 ϕ 1を変化させたときに画像全体の倍率差がどのように変化するかを表した図であり、 ϕ 1が 30° , 45° , 60° の内では 45° が最も倍率差が少なく、 ϕ 1 = 45° において θ 1、が小さいほど倍率差が少ないことがわかる。/ 又、 ϕ 1 が 60° の場合では過補正となり(倍率差が負となり)レンズ 11 に近い側での倍率がプリズ

7°とする。

一方、第6図は角 θ ・を30°に設定したときの倍率差を示す図であり、第7図は角 θ ・を50°に設定したときの倍率差を示す図である。これらの図に示すように、角 θ ・が倍率差を補正する上ではほとんど影響しないことがわかる。

しかしながら、この角 8 ・は指紋検出範囲に影響を与える。第 8 図と第 9 図は角 8 ・を変えるが発出範囲の増減を示するであるがわれている。 現在の光学系レイアウトで変換とは別のできるができる。 できるができるができる。 但し、指紋検エのを経方向の検出をできる。 但し、指紋検エースをといる。 とする。 とする。 とする。 とは 4 0 ・とする。

尚、第10図は補正プリズム8の辺DEの長さ (プリズム8の大きさ)を増減させたときの倍率 差の変化を示す図であり、この図に示すように、 辺DEの長さが変化しても倍率差はほとんど変わ らないことがわかる。

以上の最適値をまとめると以下のようになる。

- 指紋検出プリズム1の角を。は、45°直角 プリズム(直角をなす辺の長さ25 mm)を使用 し、を 3 = 45°とする。
- 2. 指紋検出プリズム 1 と補正プリズム 8 とがなす角 θ 。は、 θ 。 = 4 0 ° とする。
- 補正プリズム 8 の角 φ₁ は、φ₁ = 4 5° と する。
- 4. 指紋検出プリズム 1 及び補正プリズム 8 の材質は、光学部品として一般的な B K 7 を使用する。
- 5. 反射光線の反射角度 θ , は、 θ , = 4.7° とし、反射光 λ の被長は赤色LEDの 6.6 0 nmにする。
- 6. レンズ 1 1 の焦点距離 f は、 f = 2 5 nmとする。 (この場合、全体の倍率差が 0. 0 0 8 となる)
- 7. 画像の中心倍率mは、m=0.5とする。
- 8. CCD受光面12の長さは、2/3インチC

差の発生が防止される。その結果、指紋登録時と 指紋照合時とで指先の位置がずれても所定数の画 素を一致させて、照合率の低下を未然に防止する ことができる。

又、本実施例の指紋読取装置においては、拡散板5の厚みを指紋検出面2に近い側ほど厚く設定したため、指紋検出面2に到達する光量が均一化されるとともにCCD受光面12に結像する指紋画像の明るさも均一化される。従って、パターンマッチングのために映像信号を2値化しても指紋の凹凸を表している映像信号の消失が防止され、実際の指紋に忠実な信号を得ることができる。

尚、本実施例の指紋読取装置は以上のようにして具体的な仕様を決定したが、上記した1項から8項までの項目を適宜変更することで異なる仕様、例えば、倍率差をさらに低減させたりレンズ11の焦点距離fを短くして読取装置の小型化を図ったりすることもできる。

又、上記実施例では拡散板5の厚みを変更する。 ことで指紋検出面2に到達する光量を均一化した。 C D 素子を使用するため 6. 4 m とする。

その他 $\overline{AC} = \overline{BD} = \overline{DE} = \overline{DF} = 2.5$ mm, \overline{CD} = 5 mm, $\phi 2 = 9.0$ °上記のような設定値を決定した。

本発明者は、以上のように設定した本実施例の指紋読取装置と補正プリズム.8を備えない従来の指紋読取装置とを比較し、実際に得られた画像におけるQ点とS点との倍率差が従来の指紋読取装置では0...064倍であったのに対し、本実施例の指紋続取装置では0...07倍まで低減されたことを確認した。

このように本実施例の指紋読取装置においては、 指紋検出プリズム1とレンズ11との間に、指紋 検出面2からレンズ11の前側主点Kまでの全て の光路長の光軸Xに平行な成分を同光軸X上の光 路長とほぼ等しくなるように補正する補正プリズム8を配設した。

従って、指紋検出面2上の実際の指紋は、その 部位に関係なく全て等しい倍率でCCD受光面1 2上に指紋画像として結像し、指紋画像中の倍率

が、上記したように縦方向と横方向に整列した L ED6の配置密度を指紋検出面2側ほど疎となる ように設定してもよい。

〔発明の効果〕

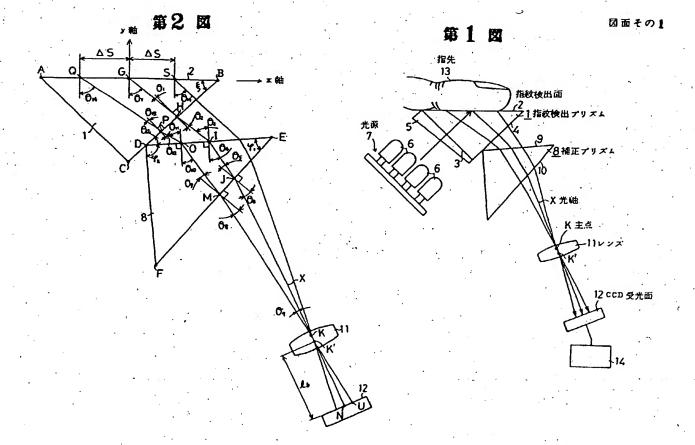
以上詳述したように本発明の指紋続取装置によれば、倍率差の発生を防止して実際の指紋に忠実 な指紋画像を得ることができるという優れた効果 を発揮する。

4. 図面の簡単な説明

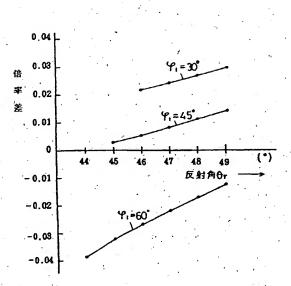
変化を示す図、第11図は実施例の指紋読取装置によって得られた指紋画像を映像信号に変換した状態を示す図、第12図は平坦な拡散板を用いたり拡散板を用いなかったりした読取装置による映像信号を示す図、第13図は従来の指紋読取装置の概略的な構成を示す図である。

1 は指紋検出部材としての指紋検出プリズム、2 は指紋検出面、7 は光源、8 は光学補正部材としての補正プリズム、1 1 はレンズ、1 2 は擬像業子としてのCCD受光面、1 3 は指先、X は光軸、K は主点。

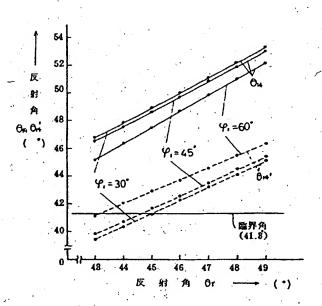
特許出願人 日本電装 株式会社 代理人 弁理士 恩田 博宣(ほか1名)



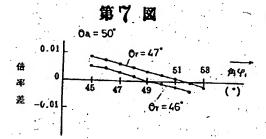
図面その2

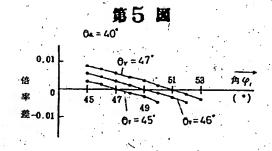


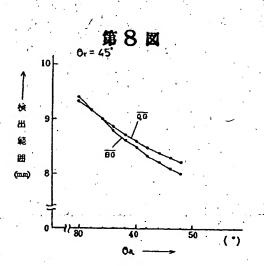
第4図

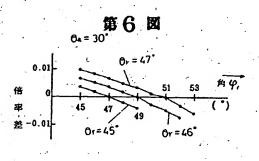


第3 図







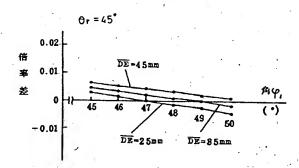


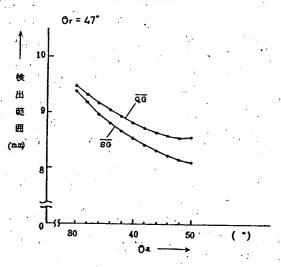
図面その8

図面その4

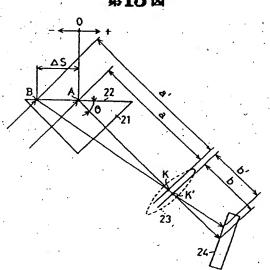
第9 图

第10図



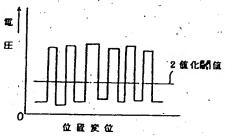


第13 図



第11回





第12 図

